

KOHエッチング装置

(型式:ETC-6001F/ETC-8001F)

SiCウエハやGaNウエハ等の熔融KOHによるエッチング処理を安全かつ精密に!!
基板カゴにウエハをセットし、エッチング開始ボタンを押すだけ

【本装置のメリット】

- ・装置が密閉されているため、処理中のKOH蒸気/溶液との接触・暴露の可能性がほとんどありません。
- ・エッチング時間を設定すれば、自動でエッチングが行われます。
- ・基板カゴが回転しているため、手動で攪拌する必要がありません。

【適用】

- ・ウエハ表面欠陥評価
- ・ウエハ表面処理

【仕様表】

型式	ETC-6001F	ETC-8001F
ルツボサイズ	Φ200×H169 (t2)	Φ250×H190 (t2)
対応ウエハサイズ	6インチ	8インチ
最高加熱温度(制御用熱電対値)	700℃	
温度安定性(制御用熱電対値)	±1℃	
基板カゴ上下機構	自動	
基板カゴ回転機構	モータ駆動 (Max. 10rpm)	
ルツボ蓋用シャッター機構	手動 (ルツボの蓋を機械的に開閉)	
液温測定用熱電対上下機構	手動 (機械位置から液温測定位置まで移動)	
電力	単相200V 20A	単相200V 30A
排気ダクト径	Φ100 ※筐体内排気用排気設備をご準備下さい	
装置サイズ(筐体)	W750×D650×H1650	W1000×D930×H2200
装置重量	190kg	350kg
オプション	シグナルタワー	

